# PARTICLE ARRAYING METHOD, AND PARTICLE ARRAYING DEVICE MANUFACTURED BY THE METHOD

Publication number: JP2003089896
Publication date: 2003-03-28
Inventor: FUSE AKIHIRO

Applicant: RICOH KK

Classification:

- International: G02B5/18: B01J19/00: B01J19/08: C25D13/02:

G02B5/18; B01J19/00; B01J19/08; C25D13/02; (IPC1-

7): C25D13/02: B01J19/00: B01J19/08: G02B5/18

- European:

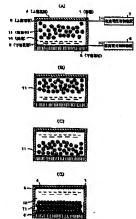
Application number: JP20010283732 20010918

Priority number(s): JP20010283732 20010918

Report a data error here

#### Abstract of JP2003089896

PROBLEM TO BE SOLVED: To array particles with high regularity even when the particles are relatively large in specific gravity and ultrafine in size. SOLUTION: The particles 11 are charged negative in Fig. 1 (A). When the positive electric field and the negative electric field are applied to an upper electrode 5 and a lower electrode 3, respectively, in this condition, the negative- charged particles 11 are attached to the upper electrode 5, and slightly moved upwardly against the gravity (Fig. 1 (B)). Then, the polarity of the upper and lower electrodes is switched immediately, and the negative electric field and the positive electric field are applied to the upper electrode 5 and the lower electrode 3, respectively, the particles 11 are attracted by the positive electric field applied to the lower electrode 3 in addition to the gravity, and moved toward the lower electrode 3 (Fig. 1 (C)). By repeating the conditions in Figs. 1 (B) and 1 (C) by adequately controlling the electric field to be applied, the particles arrayed regularly in the final state as shown in Fig. 1 (D) can be obtained.





(211227C)

Teilübersetzung

(Offenlegung)

Entgegenhaltung 2:

JP Pat.-Offenlegung Nr. 2003-089896 vom 28.03.2003

Anmeldung Nr. 2001-283732 vom 18.09.2001

Priorität: ohne

Anmelder: K.K. Ricoh, Tokyo, Japan

Titel: Verfahren zur Anordnung von Feinpartikeln und durch das

Verfahren hergestellte Vorrichtung zur Anordnung von
Feinpartikeln

Ausführliche Erläuterung der Erfindung (Auszug):

. . . . . .

[0025]

Dabei sind die Feinpartikel 11 negativ geladen. Fig. 1(B) zeigt eine schematische Ansicht des Verhaltens der Feinpartikel in diesem Zustand, wobei ein positives elektrisches Feld an die obere Elektrode 5 und ein negatives elektrisches Feld an die untere Elektrode 3 jeweils angelegt wird. Die negativ geladenen Feinpartikel 11 werden an das positive elektrische Feld der oberen Elektrode 5 herangezogen und in der der Gravitation entgegengesetzten Richtung etwas nach oben bewegt. Fig. 1(C) zeigt eine schematische Ansicht des Verhaltens der Feinpartikel

im Fall, in dem nach dem Zustand gemäß Fig. 1(B) die Polarität der oberen und unteren Elektrode gewechselt wird, d. h. ein negatives elektrisches Feld an die obere Elektrode 5 und ein positives elektrisches Feld an die untere Elektrode 3 jeweils angelegt wird. In diesem Fall werden die Feinpartikel 11 nicht nur durch die Gravitation, sondern durch das positive elektrische Feld der unteren Elektrode 3 herangezogen und nach der unteren Elektrode 3 hin bewegt. Durch geeignete Kontrolle der angelegten elektrischen Felds wird der Zustand gemäß Fig. 1(B) und der Zustand gemäß Fig. 1(C) wiederholt. Auf diese Weise können schließlich regelmäßig angeordnete Feinpartikel erhalten werden, wie in Fig. 1(D) gezeigt.

. . . . . .

# (19)日本1999年 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-89896 (P2003-89896A)

(43)公開日 平成15年3月28日(2003.3.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I	ナーマコート* ( <b>参考</b> )
C 2 5 D	13/02		C 2 5 D 13/02	2H049
B01J	19/00		B O 1 J 19/00	K 4G075
	19/08		19/08	Λ
G 0 2 B	5/18		G 0 2 B 5/18	
			審査請求 未請求 請求項の	数11 OL (全 8 頁)
(21)出順番号		特願2001-283732(P2001-283732)	(71)出願人 000006747	
			株式会社リコー	
(22) 出願日		平成13年9月18日(2001.9.18)	東京都大田区中馬	込1 万目3番6号
			(72)発明者 布施 晃広	
			東京都大田区中馬	込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内	
			Fターム(参考) 2H049 AA44 AA56	
			4Q075 AA27 A	A61 BB10 CA14 DA01
			EA01 E	B01 EC21 FA14 FB01
			FB02 F	B06 FC02

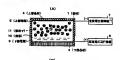
# (54) 【発明の名称】 微粒子配列方法および該方法によって製作された微粒子配列装置

# (57)【要約】

【課題】 比較的比重が大きくかつ超微粒子であっても 高規則性を有して微粒子を配列させる。

【解決手段】 図1(A)において、微粒子11は負に 帯電しているものとする。この状態で、上部電極5に正 の電界を、下部電極3に負の電界を印加すると、負に帯 電している微粒子11は上部電極5に引き寄せられ、重 力に反して若干上方へと移動する(図1(B))。この 後、すぐに、上下の電極の極性を切り替えて、上部電極 5に負、下部電極3に正の電界を印加すると、微粒子1 1は重力に加え下部電極3に印加された正の電界に引き 寄せられて下部電極3のほうに移動する(図1

(C))。印加する電界を適切に制御することによって 図1 (B)と図1 (C)の状態を繰り返すことにより、 図1(D)に示したように、最終的に規則的に配列した 微粒子を得ることができる。









#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 微粒子を配列して成る微粒子配列装置の 製造方法において、少なくとも溶液を保持することので 多名容器と、該容器の下部の下部電極と、該容器の上部 の上部電極とを用い、該容器内に微粒子を分散させた溶 液を保持し、前記下部および上部の電極もしくはどちら か一方の電板に電圧を印加することによって生じる電気 、効理象を利用して前記容器内に微粒子を規則的に配列 させることを特徴とする微数子面列方法。

【請求項2】 前記上部および下部の電極に直流の電圧 を印加する際に、極性を交互に変化させるいわゆる交番 電界を印加することを特徴とする請求項1に記載の織粒 子都列方法。

【請求項3】 前記上部または下部電極どちらか一方に 交流の電圧を印加し、他方の電極にその周波数と同期し て直流の電圧を印加することを特徴とする請求項1に記 載の徴致予配列方法。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれかにおいて、下 部および上部の電極もしくはどちらか一方の電極に印加 する電圧を徐々に減少させる工程を含むことを特徴とす る微約予配列方法。

【請求項5】 前記下部電極を上部に有する下部基材を 有し、該下部基材が多孔質材料であることを特徴とする 請求項1乃至4のいずれかに記載の微粒子配列方法。

【請求項6】 前記多孔質材料がゼオライトであることを特徴とする請求項5に記載の微粒子配列方法。

【請求項7】 前記多孔質材料がボーラスシリコンであることを特徴とする請求項5に記載の微粒子配列方法。 【請求項8】 請求項5乃至7のいずれかにおいて、微 粒子配列の際または配列後に、前記基材の細孔を通じ

松丁田のかいなよれる相の何をに、前日記がりが加れる面と て、溶液成分のみを下方に除去することを特徴とする微 粒子配列方法。

【請求項9】 前記基材上に残した配列微粒子を紫外線 硬化樹脂を用いて固定化することを特徴とする請求項8 に記載の微粒子配列方法。

【請求項10】 前記微粒子を分散させた液体の液性を、前記基材および微粒子に応じて最適化することを特徴とする請求項5乃至9に記載の微粒子配列方法。

【請求項11】 請求項1乃至10のいずれかに記載の 方法によって製作された微粒子配列装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微粒子配列方法お よび該方法によって製作された微粒子配列装置に関し、 該微粒子配列装置は、例えば、高密度記録媒体、光学素 子、表示装置などに応用できるものである。

#### [0002]

【従来の技術】微粒子を基材上に配列することに関する 技術としては、例えば、以下に示すようなものが開示さ れている。 特許 第2828374号 (微粒子の2次元凝集形成方法): 微粒子の液状分散媒体を基板表面に展開して液体 薄膜を形成し、液厚を粒子径サイズと同等かそれより小 さくし、液が蒸発する際の横方向に働く表面張力により 微粒子を2次元で凝集させて配列を行うものである。

【0003】特開平 9-230391号公報(電界配 列性粒子の再分散方法):対向する電極に電圧を印加 し、微粒子の電気泳動現象を利用して配列状態にある微 教子を再分散させるものである。

[0004] 特開平 10-229090号公標 (粒子 起列装置): 平行に形成された電極の各々に所定の順序 で電圧を印加することにより、移動電界を形成し、該移 動電界の力により微小粒子を移動し、移動中に所定の位 置に形成された開入に前記載小粒子を落としてむことに とり所定の位置に思列させるよのである。

【0005】文献:「3次元有機フォトニック結晶の新 しい形成法」

(O plus E Vol.21, No.12 200 O PP1549~1553) ボリスチレン微粒子を分散させた溶液の蒸発速度を制御し、重力による洗降を非常にゆっくりさせることにより、3次元に集積したボリスチレン微粒子を得るものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、微粒子配列 方法および該方法によって製作された微粒子配列装置に 関わるものであり、特に、比重の重い微粒子やあるが 重力のみでは自然沈降しない複数粒子であっても簡便な プロセスを用いて2次元又は3次元構造で高密度でかつ 規則的に微粒子を配列できる微粒子配列方法及び該徴粒 子配列方法によって製作された微粒子配列装置を提供す るものである。

【0007】近年、材料を微比予化することにより、パ ルク形状では得られなかった種々の特性が得られること が判明したことに加え、微比子の形状や粒栓などを精度 良く形成する方法による研究成果が発表され、その応用 面も積極的に研究されている。当然、独社子材料を微生 子そのまるの形態で利用する提案も行われているが、さ らに微粒子の特性を活かすために、微粒子を規則正しく 配列し、その結果得られる性能を利用する応用研究も盛 んである。

【0008】例えば、特許第2828374号には、微粒子の液状分散媒体を基板表面に限用して液体薄膜を形成し、液度を発酵子径サイズと同等かそれより小さくし、液が蒸発する點の横方向に働く表面張力により微粒子を2次元で業長させて配列を行う発明が開示されている。しかし、この発明によれば、待られる微粒子の配列は2次元であり、その結果応用できる分野も限られ、例えば、今後光温信分野などで削持されるフォトニック結晶に必要なる光行構造を得ることは不可能である。

【0009】また、微粒子の電気泳動現象を利用したも

のとしては、特開平9-230391号公報があり、そ の内容は対向する電極に電圧を印加し、微粒子の電気 動現象を利用して配外状態にある微粒分を手の散させて 光の透過、遮断を制御するものである。この従来技術 は、微粒子の電気泳動現象を利用した点では、本発明に 旗似する点があるといえるが、この従来技術の制御方は は、配列状態と再分散状態を制御して光の透過、遮断を 制御するものであり、本発明のごとく、高規則性の3次 元微粒子配列装置を得るものとは根本的に異なるもので ある。

【0010】上記2件の先行技術とは異なり、3次元構造が得られる技術として、前記文献(O plus E Vol.21、No.12 2000 PP1549~1553)があり、この文献には、ポリスチレン微粒子を分散させた溶液の蒸発速度を制御し、重力による沈降を非常にゆっくりさせることにより、3次元に集積したポリスチレン微粒子を得ることが開示されている。しかし、この技術は、比較的比重の軽いポリスチレン微粒子のようなものにしか適用できないという問題に加え、

「重力による沈降を非常にゆっくりさせる」という消極 的な制御技術を利用しているために、超微粒子などのよ うに、重力では沈降しない微粒子に対しては、効果のな い技術である。

【0011】本発明に最も近い技術としては、特開平1 0-229090号公報に開示されているように、平行 に形成された電極の各々に所定の順序で電圧を印加する ことにより、移動電界を形成し、該移動電界の力により 微小粒子を移動し、移動中に所定の位置に形成された開 孔に前記微小粒子を落としこむことにより所定の位置に 配列させる技術がある。しかしながら、この技術は、比 較的比重の大きい微粒子を配列させる技術としては注目 すべきものであるが、上下の電極をそれぞれ分割して形 成する必要があるという非常に複雑なプロセスを用いる ことに加え、乾燥状態での配列技術であるために、適用 できる微粒子の大きさに限界がある。すなわち、一般的 に微粒子はその特性により、粒径が小さくなればなるほ ど非常に凝集する力が大きくなり、この現象は配列する 際の大きな障害であるという点から考えると、今後、益 々必要とされる超微粒子に関しては、それ自身の有する 凝集力という障害のために、適用不可能という大きな間 題を有するものである。

【0012】本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので有り、微粒子を分散させた溶液系において、効率よく電界を印加することによって、比較的比重が大きくかつ超微粒子であっても高規則性を有して微粒子を配列させる技術を提供することを目的とするのであり、また、配列の際もしくは配列後と溶液成分のみを下方に除去する技術の融合により完成したものであり、簡便なプロセスで、糖度良く微粒子を規則的に配列する技術を提供することを目的とするものである。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】請求項1の希明法、微粒 子配列して成る微粒子配列装置の製造方法において、 少なくとも溶液を保持することのできる容器と、該容器 の下部の下部電極と、該容器の上部の上部電極とを用 い、該容器内に微粒子を分散させた溶液を保持し、前記 下部および上部の電極もしくほどちらか一方の電極に電 圧を印加することによって生じる電気泳動現象を利用し て前記容器内に微粒子を規則的に配列させることを特数 としたものである。

【0014】請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記上部および下部の電極に直流の電圧を印加する 際に、極性を交互に変化させるいわゆる交番電界を印加 することを特徴としたものである。

【0015】請求項3の発明は、請求項1の発明において、前記上部または下部電極どちらか一方に交流の電圧 を印加し、他方の電極にその周波数と同期して直流の電 圧を印加することを特徴としたものである。

【0016】請求項4の発明は、請求項1万至3のいず れかの発明において、下部および上部の電極もしくはど ちらか一方の電極に印加する電圧を徐々に減少させる工 程を含むことを特徴としたものである。

【0017】請求項5の発明は、請求項1乃至4のいず れかの発明において、前記下部電極を上部に有する下部 基材を有し、該下部基材が多孔質材料であることを特徴 としたものである。

【0018】請求項6の発明は、請求項5の発明において、前記多孔質材料がゼオライトであることを特徴としたものである。

【0019】請求項7の発明は、請求項5の発明において、前記多孔質材料がボーラスシリコンであることを特徴としたものである。

[0020] 請求項8の発明は、請求項5万至7のいずれかの発明において、微粒子配列の際または配列後に、 前記基材の細孔を通じて、溶液成分のみを下方に除去することを特徴としたものである。

【0021】請求項9の発明は、請求項8の発明において、前記基材上に残した配列微粒子を紫外線硬化樹脂を用いて固定化することを特徴としたものである。

【0022】請求項10の発明は、請求項5乃至9の発明において、前記厳粒子を分散させた液体の液性を、前 記述材材よび微粒子に応じて最適化することを特徴としたものである。

【0023】請求項11の発明は、請求項1乃至10のいずれかに記載の方法によって製作された微粒子配列装置である。

#### [0024]

【発明の実施の形態】図1は、本発明による微粒子配列 装置の製造方法を模式的に示した断面図で、図中、1は 容器、2は該容器1の下部基材、3は該下部基材2の上 に設けられた下部電極、4は容器1の上部基材、5は該 上部基材4の下に設けられた上部電極、6、7は直流電 圧制御装置で、図1(A)は容器1中に微粒子11を分 散させた溶液10が存在し、上部電極5および下部電極 3に電界が印加されていない状態を示したものである。 【0025】このとき、微粒子11は負に帯電している ものとする。図1 (B)は、この状態で、上部電極5に 正の電界を、また、下部電極3に負の電界を印加した時 の微粒子の挙動を模式的に示す。負に帯電している微粒 子11は上部電極5に印加された正の電界に引き寄せら れ、重力に反して若干上方へと移動する。図1(B) は、この後、すぐに、上下の電極の極性を切り替えて、 上部電極5に負の電界を、また、下部電極3に正の電界 を印加した時の微粒子11の挙動を模式的に示したもの である。この状態では、微粒子11は重力に加え下部電 極3に印加された正の電界に引き寄せられて下部電極3 のほうに移動する。そして、印加する電界を適切に制御 することによってこの状態、すなわち図1(B)と図1 (C) の状態を繰り返すことにより、図1(D) に示し たように、最終的に規則的に配列した微粒子を得ること ができる。

【0026】図2は、下部基村2として、多孔質材料を 用いた場合の様子を模式的に示した図で、図1(D)に 示した状態で、もしくは、電界を印加終了後に、図2に 示したように下部電極3を有する下部基材2に多孔質材 料を用いた場合には、その細孔を通じて溶液10を下方 に液滴10°として除去することにより、乾燥状態で微 物子部別態度を容易に得ることができる。

【0027】また、乾燥した状態で、例えば、図3に示したごとく、紫外線硬化樹脂20を滴下し、紫外光を照射して樹脂を硬化させて、図4に示したような、規則正しく3次元に集積した鉄粒子11の配列装置を容易に得ることができ、フォトニック結晶などへの応用がで置なる。紫外線硬化樹脂20を滴下するのは、必ずしも乾燥状態にした後である必要は無く、溶液がある状態で、紫外線硬化樹脂を滴下し、紫外光を照射して樹脂を硬化させることも可能である。

[0028]本発明は、高規則性の微型子配列装置を 溶液系を用いることにより実現することを特徴のひとつ としている、すなわち、乾燥状態では、凝集しやすくな 名超微粒子であっても、溶液系という状態の利点を最大 限に利用し分散性を向上かさることにより凝集を防ぎ、 月日の制御、例えば、添加するイオン種を遺切に選択、 制御することにより、下部電能との等電点の関係を利用 することができ、その結果、高規則性の微粒子配列が得 られるものである。

【0029】この点についてさらに詳細に説明する。一 根に、例えば、金属酸化物からなる微粒子を水中に浸漬 すると、微粒子は正または負の電荷を持ち、電界が存在 すると対向する電場を有する方向へ移動する。この現象 が電気泳動現象である。この電気泳動現象によって、散 粒子の水中における荷電すなわち界面電位 (ゼータ電 位)の存在を対しるこかできる。この界面電位は微粒子 一水系のp Hによって大きく変化する。一般に、横軸に 水系のp Hによって交化し、界面電位よの 系のp Hによって変化し、界面電位 「o」をりる点の水 系のp Hは「等電点」と定義される。この現象から、一 般的に金属酸化物酸粒子表面の界面電位は、酸性側では 正 アルカリ側では自の無件を取る。

【0030】しかし、この等電点は材料によって大きく 異なり、例えば、コロイダルシリカでは「2.0」、α 一アルミナでは「9.0」、ペアタイトでは「6.7」と いう値が紹介されている。つまり、等電点から離れるほ ど界面電位が大きくなり、酸性側にいくほど界面電位の 個は正の大きい方に向かい、また逆に、アルカリ側にい くほど界面電位の値は負の大きい方に向かう。これは 日で制御することができるものである。P H の制御は、 酸やアルカリの添加で、制御性よくコントロールできる ものである。

【0031】本発明では、この現象を積極的に利用し、 総粒子の募集を防さながら、電気泳動現象により、微粒 子を3次元で規則的に配列をせることが可能となる点が 大きな特徴である。以上述べたように、等電点の概念、 および電気途動現象を利用できない乾式のプロセスとは 根本的に異なるものである。

【0032】さらにもうひとつの特徴は、上下の電極に 印加する電界は、使用する微粒子、および溶液のPHな どにより、直流、交流、またはその両方の組み合わせを 使用することができる。また、必ずしも一定の強度の電 界を印加する必要はなく、例えば、印加する電界の強度 を徐々に弱くしていくことにより、短時間で最も安定 た状態になるように制御することも可能である点であ る。その結果、最終的に最も安定な状態、すなわち、欠 縮が無く、高規則性を持って配列した、微粒子構造体を 得ることができる。

【0033】これらの特徴により、従来の配列技術とは 異なり、通用できる戦粒子の材料、粒径の範囲が広が り、当然、乾燥状態では凝集して規則的に配列するこが 不可能な微粒子にも対応でき、その結果、応用分野もそ れにしたがって広がり、広範囲な材料から成る微粒子に 適用でき得るものになるという大きな特徴を有するもの である。

【0034】(実施例1)

(1) 下部電極を有する基材および容器の形成

(1)「昨睡電電で19 の無何のよび音がの版 50 mm×50 mm、厚さ0.5 mmの石英基板にスパ ッタリング法にて金を約2 μm成膜し、その基板表面中 央に内径20 mm×20 mm、外径22 mm、22 m m、高さ15 mmの値方体状石英管を分知の手段で接着 た、下部電極と有する基材と容器の形成を行った。また、下部電極とバンス駆動が可能な電圧削壊装置を接続

- し、正の電界を印加できるようにした。
- (2) 微粒子分散液の作製

純水90mLにコロイダルシリカ(日産化学社製 MP -4540 平均粒径=450nm 40%) 溶液を1 0mL加え、十分に攪拌して4%のコロイダルシリカ分 散液を作製した。

- 【0035】(3)上部電極を有する基材の形成 下部電極を有する基材の形成と同様の手法で、上部電極 として機能する金薄膜を有する基材を形成した。また、 ト部電極にパルス駆動が可能な電圧制御装置を接続し、 負の電界を印加できるようにした。
- (4)分散液の充填と上部電極を有する基材の設置
- (2)で作製した微粒子分散液を容器に充填し若干オー バーフローするところまで充填した。すぐに上部電極を 有する基材を覆いかぶせクランプで固定した。この状態 で容器はほぼ密閉状態となった。
- 【0036】(5)電界印加による微粒子配列 上部および下部電極にそれぞれの極性で交番電界を印加 した、電圧は50 Vで、駆動周波数は10Hzで行っ た。このときの上部および下部電極に印加した電界のタ イムチャートを示したものが図5である。この状態で2 0分間保持し、最後に、下部電極にマイナス50V印加 した状態で10分間保持した。この間にクランプをはず し、上部電極を有する基材を静かにずらし、はずした。 この状態で容器は開放状態となった。
- 【0037】(6)溶液成分の乾燥 容器が開放状態となったところで、振動を与えないよう
- に注意しながら、溶液成分が自然乾燥するのをまった。 約2時間後に乾燥が完了した。
- (7) 微粒子配列装置の評価
- 得られた3次元の微粒子配列装置を走査型電子顕微鏡 (SEM)を用いて観察を行ったところ、若干欠陥はあ るもののほぼ最密充填構造になっていることが確認され
- 【0038】(実験例2)

*†*>.

- (1) 下部電極を有する基材および容器の形成 50mm×50mm、厚さ0.5mmの石英基板にスパ ッタリング法にて金を約2 um成膜し、その基板表面中 央に内径20mm×20mm、外径22mm×22m m、高さ15mmの直方体状石英管を公知の手段で接着 し、下部電極を有する基材と容器の形成を行った。ま た。下部電極に交流の電圧が可能な電圧制御装置を接続 し、交流による電界を印加できるようにした。
- (2) 微粒子分散液の作製

実施例1と同様の条件で微粒子分散液を作製した。 【0039】(3)ト部電極を有する基材の形成 下部電極を有する基材の形成と同様の手法で、上部電極 として機能する金薄膜を有する基材を形成した。また、 上部電極にパルス駆動が可能な電圧制御装置を接続し、 負の電界を印加できるようにした。

- (4) 分散液の充填と上部電極を有する基材の設置
- (2)で作製した微粒子分散液を容器に充填し若干オー バーフローするところまで充填した。すぐに上部電極を 有する基材を覆いかぶせクランプで固定した。この状態 で容器はほぼ密閉状態となった。
- 【0040】(5)電界印加による微粒子配列

下部電極に15日2の交流による電界を印加した。電圧 は50Vで行った。上部電極には、直流による電界を印 加したが、タイミングを以下の様に制御した。下部電極 に負の電界が印加されているときのみ上部電極に正の電 界マイナス20Vを印加した。このときの上部および下 部電極に印加した電界のタイムチャートを示したものが 図6である。この状態で10分間保持し、次に、上部電 極および下部電極ともに毎秒0.2Vずつ印加電圧を減 少させて、100秒後には、下部電極に30Vの交流が 印加された状態となった。この状態で10秒保持し更に 下部電極に印加している電圧を毎秒0.2 V ずつ減少さ せた。この状態で5分間保持した。この間にクランプを はずし、上部電極を有する基材を静かにずらし、はずし た。この状態で容器は開放状態となった。

【0041】(6)溶液成分の乾燥

容器が開放状態となったところで、振動を与えないよう に注意しながら、溶液成分が自然乾燥するのをまった。

(7) 微粒子配列装置の評価

得られた3次元の微粒子配列装置を走査型電子顕微鏡 (SEM)を用いて観察を行ったところ、若干欠陥はあ るもののほぼ最密充填構造になっていることが確認され た。

- 【0042】(実施例3)
- (1) 下部電極を有する基材および容器の形成 これまでの実施例とは異なり、下部電極を有する基材と して50mm×50mm、厚さ2.5mmのゼオライト **燒結体を用いた。この基材にスパッタリング法にて金を** 約2μm成膜し、その基板表面中央に内径20mm×2 0mm、外径22mm×22mm、高さ15mmの直方 体状石英管を公知の手段で接着し、下部電極を有する基 材と容器の形成を行った。また、下部電極にパルス駆動 が可能な電圧制御装置を接続し、正の電界を印加できる ようにした.
- (2) 微粒子分散液の作製
- 実施例1と同様の条件で微粒子分散液を作製した。 【0043】(3)上部電極を有する基材の形成 50mm×50mm、厚さ0.5mmの石英基板にスパ ッタリング法にて金を約2 um成牒し、下部電極を有す る基材とした。また、下部電極にパルス駆動が可能な電 圧制御装置を接続し、負の電界を印加できるようにし
- (4) 分散液の充填と上部電極を有する基材の設置
- (2) で作製した微粒子分散液を容器に充填し若干オー バーフローするところまで充填した。すぐに上部電極を

有する基材を覆いかぶせクランプで固定した。この状態 で容器はほぼ密閉状態となった。

【0044】(5)電界印加による微粒子配列

上部および下部電極にそれぞれの極性で交番電界を印加 した。電圧は50Vで、駆動周波数は10Hzで行っ た。この状態で20分間保持し、最後に、下部電極にマ イナス50 V印加した状態で10分間保持した。この間 にクランプをはずし、上部電極を有する基材を静かにず らし、はずした、この状態で容器は開放状態となった。 【0045】(6)溶液成分の乾燥

容器が開放状態となったところで、振動を与えないよう に注意しながら、溶液成分のみがゼオライトの細孔を通 して下方に排出されるようにした。すべての溶液成分が 排出されるのに約30分を要した。

(7) 徽粒子配列装置の評価

得られた3次元の微粒子配列装置を走査型電子顕微鏡 (SEM)を用いて観察を行ったところ、ほとんど欠陥 のない最密充填構造になっていることが確認された。 【0046】(実施例4)

(1)下部電極を有する基材および容器の形成 50mm×50mm. 厚さ0.5mmの石英基板にスパ ッタリング法にて金を約2 µm成膜し、その基板表面中 央に内径20mm×20mm、外径22mm×22m m、高さ15mmの直方体状石英管を公知の手段で接着 し、下部電極を有する基材と容器の形成を行った。ま た、下部電極にパルス駆動が可能な電圧制御装置を接続 し、正の電界を印加できるようにした。

【0047】(2)微粒子分散液の作製 実施例1と同様の条件で微粒子分散液を作製した。

(3) 上部電極を有する基材の形成

下部電極を有する基材の形成と同様の手法で、上部電極 として機能する金薄膜を有する基材を形成した。また、 上部電極にパルス駆動が可能な電圧制御装置を接続し、 負の電界を印加できるようにした。

- 【0048】(4)分散液の充填と上部電極を有する基 材の設置
- (2)で作製した微粒子分散液を容器に充填し若干オー バーフローするところまで充填した。すぐに上部電極を 有する基材を覆いかぶせクランプで固定した。この状態 で容器はほぼ密閉状態となった。
- (5)電界印加による微粒子配列

上部および下部電極にそれぞれの極性で交番電界を印加 した。電圧は50Vで、駆動周波数は10Hzで行っ た。このときの上部および下部電極に印加した電界のタ イムチャートを示したものが図6である。この状態で2 O分間保持し、最後に、下部電極にマイナス50V印加 した状態で10分間保持した。この間にクランプをはず し、上部電極を有する基材を静かにずらし、はずした。 この状態で容器は開放状態となった。

【0049】(6)紫外線硬化樹脂による微粒子配列装

#### 置の固定

容器が開放状態となったところで、振動を与えないよう に注意しながら、紫外線硬化樹脂(スリーボンド社製 一液性紫外線硬化樹脂)を5mL静かに滴下した。紫外 線照射装置(波長:312nm)を用いて、1分間紫外 線の照射を行った。これにより、固定化された微粒子配 列装置が得られた。

(7) 微粒子配列装置の評価

得られた3次元の微粒子配列装置を走査型電子顕微鏡 (SEM)を用いて観察を行ったところ、ほとんど欠陥 のない最密充填構造の3次元の微粒子配列装置になって いることが確認された。

【0050】(実施例5)

(1) 下部電極を有する基材および容器の形成 実施例3と同様に、下部電極を有する基材として50m m×50mm、厚さ2.5mmのゼオライト焼結体を用 いた。この基材にスパッタリング法にて金を約2μm成 膜し、その基板表面中央に内径20mm×20mm、外 径2.2mm×2.2mm、高さ1.5mmの直方体状石英管 を公知の手段で接着し、下部電極を有する基材と容器の 形成を行った。また、下部電極にパルス駆動が可能な電 圧制御装置を接続し、正の電界を印加できるようにし

【0051】(2)微粒子分散液の作製 実施例1と同様の条件で微粒子分散液を作製した。

(3) 上部電極を有する基材の形成

50mm×50mm. 厚さ0.5mmの石英基板にスパ ッタリング法にて金を約2 µm成膜し、下部電極を有す る基材とした。また、下部電極にバルス駆動が可能な電 圧制御装置を接続し、負の電界を印加できるようにし

【0052】(4)分散液の充填と上部電極を有する基 材の設置

- (2)で作製した微粒子分散液を容器に充填し若干オー バーフローするところまで充填した。すぐに上部電極を 有する基材を覆いかぶせクランプで固定した。この状態 で容器はほぼ密閉状態となった。
- (5) 電界印加による微粒子配列

上部および下部電極にそれぞれの極性で交番電界を印加 した。電圧は50Vで、駆動周波数は10Hzで行っ た。この状態で20分間保持し、最後に、下部電極にマ イナス50 V印加した状態で10分間保持した。この間 にクランプをはずし、上部電極を有する基材を静かにず らし、はずした。この状態で容器は開放状態となった。 【0053】(6)紫外線硬化樹脂による微粒子配列装

容器が開放状態となったところで、振動を与えないよう に注意しながら、図3に模式的に示したように、紫外線 硬化樹脂(スリーボンド社製 一液性紫外線硬化樹脂) を5mL静かに滴下し、紫外線照射装置(波長:312

nm)を用いて、3分間紫外線の照射を行った。これにより、固定化された微粒子配列装置が得られた。

# (7) 微粒子配列装置の評価

得られた3次元の微粒子配列装置を走査型電子顕微鏡

(SEM)を用いて観察を行ったところ、ほとんど欠陥 のない最密充填構造の3次元の微粒子配列装置になって

# いることが確認された。 【0054】(実施例6)

# (1) 下部電極を有する基材および容器の形成

50mm×50mm、厚さ0.5mmの石英基板にスパッタリング法にて金を約2mm成階し、その基板表面中央に内径20mm×20mm、外径22mm×22m 、高さ15mmの直方体水石英管を公知の手段で接着し、下部電極を有する基材と容器の形成を行った。また、下部電板にパルス駆動が可能な電圧制制装置を接続し、これまでの実施例とは異なり負の電界を印加できるようにした。この理由は以下に説明する。

# 【0055】(2)微粒子分散液の作製

本実施例では、これまでの実施例とは異なり、純水90 π Lにアルミナ酸粒子 (アドマテッス社製 AO-5) 2 平野地球に分散させ、更に液性を酸性に削削するために、塩酸 (関東化学 社製 JIS特級 35.0-37.0%)を200 μし 添加した、分散液の PHは12.55」であった。この ようにする理由は、以下のことによる。つまり、アルミナ酸粒子の零電点は一般的に「9.0」といわれている ので、純水のように、中性、(PH=7.0)の溶液では 界面電位がそれほど大きくはない。従って、アルミナ酸 粒子を削削性良く電気流動させるには、液性を酸性側に して、界面で位を大きくすることが有効である。 のごとく、溶液系を用いることにより、液性も制御が可 能となり、幅広い材料への応用が可能となるものである。

# 【0056】(3)上部電極を有する基材の形成

下部電極を有する基材の形成と同様の手法で、上部電極 として機能する金澤膜を有する基材を形成した。また、 上部電極にパルス駆動が可能な電圧制御装置を接続し、 下の電界を印加できるようにした。

# (4)分散液の充填と上部電極を有する基材の設置

(2)で作製した微粒子分散液を容器に充填し若干オー バーフローするところまで充填した。すぐに上部電極を 有する基材を覆いかぶせクランプで固定した。この状態 で容器は32容割状態となった。

# 【0057】(5)電界印加による微粒子配列 上部および下部電極にそれぞれの極性で交番電界を印加 した。電圧は50Vで、駆動周波数は10Hzで行っ た。このときの上部および下部電極に印加した電界のタ

イムチャートを示したものが図6である。この状態で2 0分間保持し、最後に、下部電極にマイナス50V印加 した状態で10分間保持した。この間にクランプをはず し、上部電極を有する基材を静かにずらし、はずした。 この状態で容器は開放状態となった。

# 【0058】(6)溶液成分の乾燥

容器が開放状態となったところで、振動を与えないよう に注意しながら、溶液成分が自然乾燥するのをまった。 約2時間徐に乾燥が完了した。

# (7) 微粒子配列装置の評価

得られた3次元の微粒子配列装置を走査型電子顕微鏡 (SEM)を用いて観察を行ったところ、若干欠陥はあ るもののほぼ最密充填構造になっていることが確認され た

# [0059]

【発明の効果】請求項1に対応する作用効果

溶液系、すなわち微粒子を分散させた溶液を容器に保持 し、下部および上部の電極に電圧を印加することによっ て微粒子を配列させるために、重力のみでは沈降しない 超微粒子であっても、高規則性を有する微粒子配列装置 を作成さることができる。

#### 【0060】請求項2に対応する作用効果

前記上部および下部電極に直流の電圧を印加する際に極 性を交互に変化させる、いわゆる交番電界を印加するた めに、重力による沈降と、電界による移動を最適に制御 することができる。

#### 【0061】請求項3に対応する作用効果

前記上絡または下部電極どちらか一方に交流の電圧を印加し、他方の電極にその周波数と同期して直流の電圧を 即加するために、簡単なプロセスで、制御性良く微粒子 を配列させることができる。

#### 【0062】請求項4に対応する作用効果

電極に印加する電圧を徐々に減少させる工程を含むこと を特徴としているので、効率よく、短時間で、最も安定 な状態、すなわち、欠陥が無く、高規則性を持って配列 した、微数子構造体を得ることができる。

# 【0063】請求項5に対応する作用効果

下部電極を有する下部基材が多孔質材料であるために、 微粒子配列の際、または配列後に、溶液成分のみを下方 に除去することができ、乾燥状態の3次元微粒子配列装 層を容易に得ることができる。

#### 【0064】請求項6に対応する作用効果

多孔質材料がゼオライトであるために、安全でかつ取り 扱いが容易であり、溶液成分の通過速度が速いという効果が得られる。

#### 【0065】請求項7に対応する作用効果

多孔質材料がポーラスシリコンであるために、安全でか つ取り扱いが容易であり、溶液成分の通過速度が速いと いう効果が得られる。

# 【0066】請求項8に対応する作用効果

下部電極を有する下部基材が多孔質材料であるために、 微粒子配列の際、または配列後に、溶液成分のみを下方 に除去することができ、乾燥状態の3次元微粒子配列装 置を容易に得ることができる。また、欠陥がなく微細で かつ高規則性を持った配列微粒子を有する装置が容易に 得られる.

#### 【0067】請求項9に対応する作用効果

配列した微粒子を紫外線硬化樹脂を用いて固定化するために、フォトニック結晶などの光学部品、その他の応用が容易に可能となる。

#### 【0068】請求項10に対応する作用効果

徽粒子を分散させた液体の液性を、基材および微粒子に 応じて最適化するために、欠陥がなく微細でかつ高規則 性を持った配列微粒子を有する装置が容易に得られる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による微粒子配列装置の製造方法を模式的に示した断面図である。

【図2】 下部基材として多孔質材料を用いた場合の様

子を模式的に示した図である。

【図3】 紫外線硬化樹脂を滴下し、紫外光を照射して 樹脂を硬化させる場合の例を模式的に示した図である。

【図4】 本発明の方法によって制作された微粒子配列 装置の例を示す図である。

【図5】 上部および下部電極に印加する電界のタイム チャートの一例を示す図である。

【図6】 上部および下部電極に印加する電界のタイム チャートの他の例を示す図である。

# 【符号の説明】

1…容器、2…下部基材、3…下部電極、4…上部基 材、5…上部電極 6,7…直流電圧制御装置、10… 溶液、10′…液滴、11…微粒子、20…紫外線硬化 樹脂。

